

# 実用機器分析【3】 X線分析の基礎と応用

【日時】 2016/6/9 (木) 13:00-17:00

【場所】 九州大学伊都キャンパス・工学部第3講義室 (西講義棟3F)

【主催】 九州大学中央分析センター

【共催】 九州大学ナノテクノロジープラットフォーム

【協力】 株式会社リガク

### 13:00-14:10 基礎から学ぶX線回折

X線とは? から始まり、ミラー指数や結晶構造、汎用的なX線回折装置まで、基礎から分かりやすく解説します。

### 14:10-15:10 ここまでできるX線回折 ～最新の応用例まで～

in-situ測定、微小部測定、結晶子サイズ・粒径解析、リートベルト法を用いた評価など、X線回折を利用した各評価の基本的な内容から最新の応用例までご紹介します。

### 15:20-16:20 薄膜X線分析の基礎を知る

X線回折による薄膜材料分析の基礎と、X線反射率法による膜厚評価の原理と応用例を分かりやすく解説します。

### 16:20-17:00 X線回折装置を活用する

中央分析センターに設置されている全自動水平型多目的X線回折装置「SmartLab」とX線解析ソフトウェア「PDXL」を活用するために両者について解説します。

中央分析センターでは2007年から毎年定期的に分析基礎セミナーを開催しています。これは機器分析の原理・基礎知識を習得してより効果的に分析機器を使用していただくことを目的とするものです。今年度は「実用」を中心に、教科書では学べない内容も提供していきます。今回はX線回折に関して知識が得られる内容です。学内外どなたでもご参加できます。事前の参加登録にご協力をお願いします。

#### 【問合せ・申込先】

九州大学中央分析センター伊都分室 渡辺

Tel.092-802-2857

watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp